



Laborprotokoll

# Fachlabor Mikromechatronik

angefertigt von

**Viviane Bremer, Justus Drögemüller, Manisch Kumar**

Matr.-Nr.: 4254652, 4427984, 1234567

am

**Institut für Mikrotechnik  
Technische Universität Braunschweig**

**Juli 2017**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>1</b>
1.1	Zielsetzung und Gliederung . . . . .	1
1.2	Geschichte/Literatur . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Preliminary Design</b>	<b>2</b>
2.1	Wert und Einheit . . . . .	2
2.2	Überschrift . . . . .	2
2.3	Anforderungen an einen Drucksensor (Viviane Bremer) . . . . .	2
<b>3</b>	<b>FEM-Simulation</b>	<b>3</b>
3.1	Einfluss der Membrandicke auf die maximale Spannung (Viviane Bremer)	3
3.2	Einfluss der Membranabmessungen auf den Spannungsverlauf . . . . .	3
3.2.1	Einfluss der Bossgröße (Viviane Bremer) . . . . .	3
<b>4</b>	<b>Etching Process</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Characterising</b>	<b>7</b>
5.1	Wert und Einheit . . . . .	7
5.2	Überschrift . . . . .	7
5.3	Abbildungen einbinden . . . . .	7
<b>6</b>	<b>Circuit Layout</b>	<b>9</b>
6.1	Wert und Einheit . . . . .	9
6.2	Überschrift . . . . .	9
6.3	Abbildungen einbinden . . . . .	9
<b>7</b>	<b>Evaluation Circuit</b>	<b>11</b>
7.1	Wert und Einheit . . . . .	11
7.2	Überschrift . . . . .	11
7.3	including pictures . . . . .	11
<b>8</b>	<b>Zusammenfassung und Ausblick</b>	<b>13</b>
	<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>14</b>
	<b>appendix</b>	<b>15</b>
A.1	Erster Anhang . . . . .	15
A.2	Zweiter Anhang . . . . .	15

# **1 Introduction**

Hier stehen einige einführende Worte in das Thema der Arbeit.

## **1.1 Zielsetzung und Gliederung**

Was ist Sinn und Zweck der Arbeit, wie ist sie aufgebaut und welche Themen werden behandelt [Ost01b].

## **1.2 Geschichte/Literatur**

Optionale Betrachtung der Thematik wie sie in der Geschichte und/oder Literatur Erwähnung findet. Hier sollten auch schon der eine [Ost01a] oder andere [Ost02] Literaturverweise auftauchen.

## 2 Preliminary Design

### 2.1 Wert und Einheit

Viele Einheiten lassen sich schöner darstellen mit dem „Tag“ `\unit[]{}` beziehungsweise `\unitfrac[]{}{}`. Siehe den Vergleich: ohne 1 m oder mit 1 m bzw. ohne 1 m/sec oder mit 1 m/sec.

### 2.2 Überschrift

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

### 2.3 Anforderungen an einen Drucksensor (Viviane Bremer)

Für die Auswertung des morphologischen Kastens muss zunächst eine Anforderungsliste erstellt werden. Es soll ein Drucksensor zur Überwachung des Gasdrucks in einer Niederdruck-Pneumatikleitung entwickelt werden. Dieser Druck liegt gewöhnlich zwischen 0 und 1 bar, kann jedoch auf maximal 1,2 bar ansteigen. Die Messgenauigkeit sollte hierbei mindestens bei  $\pm 50$  bar liegen. Eine Änderung des Druckes verläuft sehr langsam und kann somit als quasi-statisch angesehen werden. Da der Sensor in eine bestehendes Gehäuse integriert wird, dürfen seine Abmaße 10x10 mm nicht überschreiten. Das Ausgangssignal soll einer Ausgangsspannung von 0 bis 1 V entsprechen und somit den anliegenden Druck in bar repräsentieren. Zur Spannungsversorgung steht eine symmetrische Spannung von 12 V und eine Referenzspannung von 1 V zur Verfügung. Des Weiteren wird mit einem Bedarf von 2.000.000 Stück gerechnet. Die Fertigungskosten sollten bezogen auf die Stückzahl so gering wie möglich ausfallen.

Diese Anforderungen sind nach Fest-, Mindest- und Wunschanforderung in Tabelle **blubb** aufgelistet.

—>morphologischen Kasten bewerten

## 3 FEM-Simulation

### 3.1 Einfluss der Membrandicke auf die maximale Spannung (Viviane Bremer)

In diesem Abschnitt wird der Einfluss der Membrandicke auf die auftretende mechanische Spannung in der Membran betrachtet. Hierfür werden folgende Dicken genutzt:  $15\text{ }\mu\text{m}$ ,  $25\text{ }\mu\text{m}$ ,  $35\text{ }\mu\text{m}$ .

Zur Analyse wird der anliegende Druck für alle drei Membrandicken in 0.2 bar Schritten von 0.2 bar bis 1 bar erhöht und die resultierende mechanische Spannung ermittelt. Die Verläufe sind in Abbildung **blubb** dargestellt. Die Bruchspannung  $\sigma_{Br}$  von Silizium beträgt 830 MPa und sollte während des Sensorbetriebs nicht überschritten werden. Zur besseren Visualisierung ist sie als Konstante im Graphen dargestellt.

Membran a erreicht die Bruchspannung schon bei einem Druck von 0.439 bar, welcher im benötigten Messbereich liegt. Im Falle von Membran b wird sie knapp oberhalb des Messbereichs bei 1.05 bar erreicht. Die Bruchspannung bei Membran c entspricht einem anliegenden Druck von 2 bar, welcher deutlich oberhalb des Messbereiches ist. Hieraus lassen sich Erkenntnisse für das Sensorverhalten gewinnen. Membran a ist zu dünn für diese Messaufgabe, da sie innerhalb des Messbereichs reißt. Jedoch ist Membran c auch nicht akzeptabel, da niedrige Spannungen auftreten im Vergleich zu Membran b. Diese bildet einen guten Kompromiss für die gewünschte Aufgabe.

### 3.2 Einfluss der Membranabmessungen auf den Spannungsverlauf

#### 3.2.1 Einfluss der Bossgröße (Viviane Bremer)

Zur Analyse des Einflusses der Bossgröße wird die Membrangröße auf  $3600\text{ }\mu\text{m}$  und die Membrandicke auf  $25\text{ }\mu\text{m}$  gesetzt. Die Bossgröße wird folgendermaßen variiert:  $800\text{ }\mu\text{m}$ ,  $1000\text{ }\mu\text{m}$ ,  $1200\text{ }\mu\text{m}$ .

Die Spannungsverläufe und Verschiebungen sind in Abbildung **blubb** dargestellt. Bei einer Bossgröße von  $800\text{ }\mu\text{m}$  treten Spannungen von bis zu 274 MPa auf. Eine Vergrößerung des Bosses auf  $1000\text{ }\mu\text{m}$  führt zu einer maximalen Spannung von 178 MPa. Der größte Boss senkt die auftretende Spannung auf 128 MPa. Des Weiteren ist zu sehen,

dass eine Vergrößerung des Bosses zu einer Angleichung der Spannungsspitzen führt und die Dehnung der Membran von  $374\,\mu\text{m}$  auf  $77\,\mu\text{m}$  senkt.

## 4 Etching Process

(Viviane Bremer)

Für die Erstellung der Sensormembran muss zunächst der Ätzprozess charakterisiert werden. Zur Berechnung des zu ätzenden Volumens wird folgende Volumenformel eines Pyramidenstumpfes,

$$V = \frac{h}{3}(A_1 + \sqrt{A_1 A_2} + A_2), \quad (4.1)$$

benötigt. Für die Fertigung wird ein 4Wafer mit einer Dicke von  $450 \mu m$  genutzt. Die zu erzeugende Membran ohne Boss hat eine Breite von  $4000 \mu m$  und eine Dicke von  $25 \mu m$ . Dies führt zu einer Ätzhöhe von

$$h = 450 \mu m - 25 \mu m = 425 \mu m. \quad (4.2)$$

Die Fläche  $A_1$  bestimmt sich mit der Membranbreite zu

$$A_1 = a_1^2 = 4000 \mu m \cdot 4000 \mu m = 16 mm^2. \quad (4.3)$$

Fläche  $A_2$  ergibt sich mit

$$\tan(54,7^\circ) = \frac{425 \mu m}{\Delta a} \quad (4.4)$$

$$\Delta a = \frac{425 \mu m}{\tan(54,7^\circ)} = 300 \mu m \quad (4.5)$$

$$a_2 = a_1 - 2\Delta a = 3400 \mu m \quad (4.6)$$

zu

$$A_2 = a_2^2 = 11,56 mm^2. \quad (4.7)$$

Dies eingesetzt in Gleichung 4.1 ergibt für das zu ätzende Volumen

$$V_{Si} = \frac{0.425 mm}{3}(16 + \sqrt{16 \cdot 11.56} + 11.56) mm^2 = 5.831 mm^3. \quad (4.8)$$

Die Dichte  $\rho_{Si}$  von Silizium beträgt  $0.002336 \text{ g/mm}^3$ . Dies führt mit dem errechneten Volumen zu einer Masse von

$$m_{Si} = \rho V_{Si} = 0.0137 \text{ g} \quad (4.9)$$

Mit der Molmasse von Silizium,  $M_{Si} = 28.09 \text{ g/mol}$ , ergibt sich die Stoffmenge zu

$$n_{Si} = \frac{m_{Si}}{M_{Si}} = 4.877 \cdot 10^{-4}. \quad (4.10)$$



# 5 Characterising

## 5.1 Wert und Einheit

Viele Einheiten lassen sich schöner darstellen mit dem „Tag“ `\unit[]{}` beziehungsweise `\unitfrac[]{}{}`. Siehe den Vergleich: ohne 1 m oder mit 1 m bzw. ohne 1 m/sec oder mit 1 m/sec.

## 5.2 Überschrift

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

## 5.3 Abbildungen einbinden

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

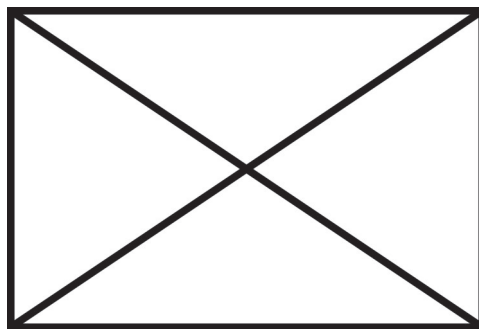


Abbildung 5.1: Einzelne Abbildung

[illegible]

# 6 Circuit Layout

## 6.1 Wert und Einheit

Viele Einheiten lassen sich schöner darstellen mit dem „Tag“ `\unit[]{}` beziehungsweise `\unitfrac[]{}{}`. Siehe den Vergleich: ohne 1 m oder mit 1 m bzw. ohne 1 m/sec oder mit 1 m/sec.

## 6.2 Überschrift

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

## 6.3 Abbildungen einbinden

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

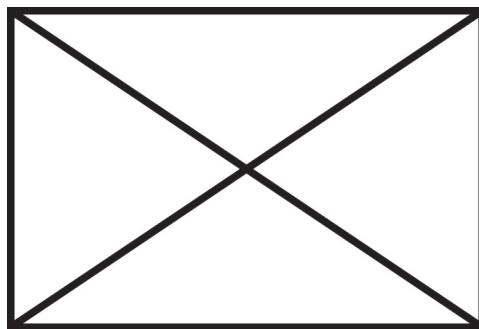


Abbildung 6.1: Einzelne Abbildung



# 7 Evaluation Circuit

## 7.1 Wert und Einheit

Viele Einheiten lassen sich schöner darstellen mit dem „Tag“ `\unit[]{}` beziehungsweise `\unitfrac[]{}{}`. Siehe den Vergleich: ohne 1 m oder mit 1 m bzw. ohne 1 m/sec oder mit 1 m/sec.

## 7.2 Überschrift

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

## 7.3 including pictures

Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text  
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text

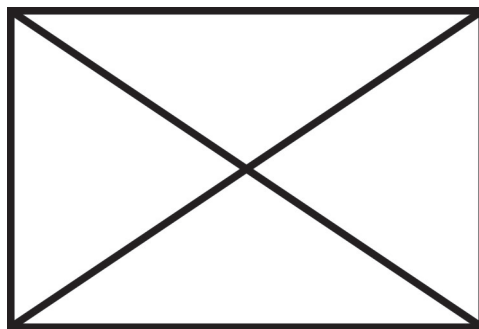


Abbildung 7.1: Einzelne Abbildung



## **8 Zusammenfassung und Ausblick**

Hier stehen die Ergebnisse der Arbeit und ein kurzer Ausblick wie es weiter gehen kann.

# Literaturverzeichnis

- [Ost01a] OSTERMEYER, G.-P.: *Schriften zur Mechanik*. Bd. 1: *Mechanik I - Grundlagen, Statik starrer Körper, Statik elastischer Körper*. Braunschweig : TU Braunschweig, 2001. – ISBN 3-936148-01-5
- [Ost01b] OSTERMEYER, G.-P.: *Schriften zur Mechanik*. Bd. 5: *Mechanik III - Kontinuumschwingungen, Prinzipien der Mechanik, Hydromechanik*. Braunschweig : TU Braunschweig, 2001. – ISBN 3-936148-05-8
- [Ost02] OSTERMEYER, G.-P.: *Schriften zur Mechanik*. Bd. 2: *Mechanik II - Stabilität, Kinematik und Kinetik, Schwingungen, Stoß*. Braunschweig : TU Braunschweig, 2002. – ISBN 3-936148-02-3



# **Appendix**

## **A.1 Erster Anhang**

Ein Anhang.

## **A.2 Zweiter Anhang**

Ein weiterer Anhang.